내외경제TV **(Korea)**

**EV Group wins contract to supply 'LITHOSCALE maskless lithography system' from PMT - January 24, 2024**

PMT has ordered a LITHOSCALE® maskless exposure system from EVG. Incorporating EVG's MLE™ (maskless exposure) technology, LITHOSCALE addresses lithography needs for markets and applications that require a high degree of flexibility or product variation. LITHOSCALE tackles legacy bottlenecks by combining powerful digital processing that enables real-time data transfer and immediate exposure, high structuring resolution and throughput scalability. MEMS manufacturing in particular poses challenges for lithography due to its complex product mixes, which drive up mask overhead costs. LITHOSCALE's mask-free approach eliminates mask-related consumables, addressing the demand for low-cost-of-ownership patterning in wafer probe card manufacturing.

내외경제TV

종합 정치 경제 사회 산업 문화 전국 오피니언

EV Group, 피엠티로부터 'LITHOSCALE® 마스크리스 노광 시스템' 공급 계약 수주

- EVG의 LITHOSCALE® 마스크리스 노광 솔루션, 미세 피치 프로브 카드에 최적

EV Group은 피엠티로부터 자사의 'LITHOSCALE® 마스크리스 노광 시스템'에 대한 공급 계약을 수주했다.

EVG의 LITHOSCALE 시스템은 피엠티 본사(충남 아산시 소재)에 설치되어 첨단 NAND, DRAM, 고대역폭 메모리 디바이스의 웨이퍼 레벨 테스트용 차세대 MEMS 기반 프로브 카드 제조에 사용될 예정이다.

LITHOSCALE은 실시간 데이터 전송과 즉각적인 노광을 가능하게 하는 디지털 프로세싱 능력과 높은 구조적 분해능 및 생산 처리량 확장성을 결합함으로써, 기존 리소그래피 방식의 병목 문제를 해결한다.

MEMS 제조는 특히 미세공정의 복잡성으로 인해 공정 난이도가 높으며, 그 결과 마스크 제조 비용 증가를 피할 수 없는 한계가 있다.

마스크를 사용하지 않는 LITHOSCALE은 높은 초점 심도와 고분해능(2μm 수준의 L/S)의 성능을 보장함에 따라, 마스크를 사용하지 않고도 미세 피치 프로브 카드의 핵심 기술인 고밀도 재배선 레이어와 비아 연결이 가능하게 해준다.

EVG 한국지사의 운영식 지사장은 "피엠티가 자사 제품 포트폴리오를 확장하고 개발 시간을 단축할 수 있도록 돕게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.

피엠티의 조용호 대표이사는 "기존의 마스크 얼라이너를 이용한 리소그래피 공정을 EVG의 마스크리스 노광 장비인 LITHOSCALE로 대체함으로써 제조 비용 절감이 가능하고 프로세스 성능도 향상할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

최신뉴스

롯데호텔 운영 최고급 실버타운

https://www.nbntv.co.kr/news/articleView.html?idxno=3009631